B　Field Evaporation System
a　This system should have a high-voltage power supply unit for generating ion field evaporation from apex of specimen as base voltage.
b　This system should have a high-voltage pulser for controlling ion field evaporation from apex of specimen as well as for T0 signal of TOF mass spectrometry.
c　This system should have a specimen stage with 3-axes motion control.
d　This system should have local electrode, which is enable to localize electric field at specimen, reducing voltage for required field.
e　This system should have a cryogenic system for cooling specimen.
C　Vacuum System : This system should consist of 3 chambers with isolation valves between chambers. This system also should have individual vacuum gages to monitor vacuum levels of each chamber.
D　Data Analysis System
a　This system should have analysis software.
b　This system should have analysis software, which is capable of atomic cluster detection functions.
c　This system should have analysis software, which is capable of creating cluster statistic results.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 13, June, 2013
⑹　Contact point for the notice : Kazuo Shigemitsu, Project Support Section, Promotion of Science and Technology Division, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto-Daigaku-Katsura, Nishikyo-Ku, Kyoto-shi 615―8530 Japan, TEL 075―383―2101

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年5月13日
国立大学法人京都大学長　松本　紘

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第４号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
動的ナノ力学解析装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　高分解能観察が可能な200kV級のLaB６電子銃を搭載し、低倍率から高倍率まで高コントラストが得られる対物レンズを備えた透過型電子顕微鏡であること。明確な明視野像・暗視野像を得るためにはビームの平行性が必要であり、長焦点レンズで後焦点面に挿入される絞りを備えていること。また、応力下における材料の動的観察を目的としており、二重のＯリングを備えたホルダでコンタミネーションを低減する対策や試料移動に伴う微小リークがない方式であること。
B　その場観察用カメラ　その場観察対応用カメラとして、広視野観察及び電子線回折を取得できるサイドマウント形カメラと高倍率で高フレームレートを実現したボトムカメラを備えていること。
C　二軸傾斜ホルダ　高倍率下での電子顕微鏡観察や電子回折実験を行うため、試料ドリフトなどに対し、試料支持部分の強度を高め、耐震性能に優れた二軸傾斜ホルダを備えていること。
D　二軸傾斜ナノインデンテーションホルダ　材料の微視的な変形過程を直接観察することが可能な二軸傾斜ナノインデンテーションホルダを備えていること。
E　ピコインデンテーションホルダ　粒界や析出物などの不均一なナノスケール組織の局所領域の変形挙動を解析するに当たり、荷重・時間の制御に加え、変位の高精度制御が可能なインデンテーションホルダを備えていること。
F　液中観察ホルダ　液中下における材料を動的に観察する研究実験に対し、液層、流量を選択しながらその場高分解能観察ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年６月13日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒615―8530 京都市西京区京都大学桂　京都大学桂地区（工学研究科）学術協力課プロジェクト事務支援室　重光　一夫　電話075―383―2101
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年５月13日から平成25年６月13日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年５月23日14時00分
⑵　開催場所　東京大学工学部12号館２階会議室（本郷キャンパス）
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : In-situ nano mechanical characterization system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　To observe the material deformation processes at high magnification with enhanced image contrasts in bright field and dark field imaging mode, transmission electron microscope with LaB6 gun, maximum 200 kV accelerating voltage and optimized objective lens is required. In order to observe mechanical responses under liquid environment in-situ, the specimen holder should have double O-ring structure without leakage during the specimen motion.
B　The side-mount type CCD camera capable of observing large field of view and detecting electron diffraction pattern is required. In addition, bottom-mount type camera capable of observing high frame rate video images at high magnification is required.
C　Double-tilt specimen holder providing high vibration-proof performance is required.
D　The double-tilt nano-indentation holder capable of direct observation of deformation processes of materials at high magnification is required.
E　The indentation holder which can precisely control load, time and displacement is required.
F　To observed mechanical responses at liquid environment, liquid cell holder for TEM is required.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 13, June, 2013
⑹　Contact point for the notice : Kazuo Shigemitsu, Project Support Section, Promotion of Science and Technology Division, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Kyoto-Daigaku-Katsura, Nishikyo-Ku, Kyoto-shi 615―8530 Japan, TEL 075―383―2101

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成25年5月13日
国立大学法人鹿児島大学
契約担当役理事　渡辺　政美

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　46

○第３号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　放射線診断治療システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成25年度３月以降